⑹ Qualifications for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :

A　not come under Article 3 and 4 of the Regulation concerning the Contract for National University Corporation Tokai National Higher Education and Research System,

B　have the Grade A or Grade B qualification during fiscal 2021 in the Tokai・Hokuriku area in sales of product for participating in tenders by Single qualification for every ministry and agency, or in tenders by National University Corporation Tokai National Higher Education and Research System,

C　prove to have obtained the first-class license for selling drugs in accordance with the Law on Securing Quality, Efficacy and Safety of Products including Pharmaceuticals and Medical Devices,

D　prove to have the ability to deliver the products, required by this notice, on the date and to the place specified by the Obligating Officer,

E　meet the qualification requirements which Chancellor, National University Corporation, Tokai National Higher Education and Research System may specify in accordance with Article 5 of the Regulation,

F　not be currently under a suspension of business order as instructed by Chancellor, National University Corporation, Tokai National Higher Education and Research System.

⑺ Time limit of tender : 16 : 00　13 September, 2021

⑻ Contact point for the notice : Nobuyoshi Sakai, Accouting Division, Nagoya University School of Medicine, Tokai National Higher Education and Research System, 65 Tsurumai-cho Showa-ku Nagoya-shi 466―8560 Japan, TEL 052―744―2808

⑼ Please be noted that if it is indicated that environmental conditions relating to the procurement are laid down in its tender documents.

## 入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

令和３年７月21日

国立大学法人京都大学長　湊　　長博

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　26

**○第33号**

1　調達内容

⑴　品目分類番号　24

⑵　購入等件名及び数量

A　高速シーケンサーゲノム解析システム　一式

B　高精度プラズマエッチング装置　一式

C　電子線描画高速偏向制御システム　一式

⑶　調達件名の特質等　入札説明書による。

⑷　納入期限　上記１⑵の件名ごとに次のとおりとする。

A　令和３年９月30日

BC　令和４年３月31日

⑸　納入場所　上記１⑵の件名ごとに次のとおりとする。

A　京都大学医学部附属病院

BC　京都大学大学院工学研究科

⑹　入札方法　上記１⑵の件名ごとにそれぞれ入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2　競争参加資格

⑴　国立大学法人京都大学契約事務取扱規則第４条の規定に該当しない者であること。

⑵　入札者の競争参加資格　上記１⑵の件名ごとに次のとおりとする。

A　国の競争参加資格（全省庁統一資格）において令和３年度（平成33年度）に近畿地域の「物品の製造又は物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

BC　国の競争参加資格（全省庁統一資格）において令和３年度（平成33年度）に近畿地域の「物品の製造又は物品の販売」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。

なお、当該競争参加資格については、令和３年３月31日付け号外政府調達第60号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。

⑶　入札説明書で指定する内容等を満たす者であること。

⑷　購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。

⑸　国立大学法人京都大学から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

3　入札書の提出場所等

⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先

〒606―8501 京都市左京区吉田本町　京都大学財務部経理課経理調達掛　山田　絵美

電話075―753―2167

⑵　入札説明書の交付方法　本公告の日から上記３⑴の交付場所にて交付する。また、電子メールによる交付を希望する場合は、件名、社名、担当者名及び連絡先（所在地、電話番号等）を明記し、seicho@mail2.adm.kyoto-u.ac.jpに申し込むこと。申し込む際の電子メールの件名は、【社名】「(件名）の入札説明書交付希望」とすること。電子メールによる申し込み受信確認後、申込者にデータのダウンロード用ＵＲＬを記したメールを返信する。

⑶　入札書の受領期限　上記１⑵の件名ごとに次のとおりとする。

A　令和３年８月13日17時00分

BC　令和３年９月10日17時00分

⑷　開札の日時及び場所　上記１⑵の件名ごとに次のとおりとする。

A　令和３年８月31日15時00分　京都大学財務部第二会議室

B　令和３年10月15日14時00分　京都大学財務部第二会議室

C　令和３年10月15日15時00分　京都大学財務部第二会議室

4　その他

⑴　契約手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨。

⑵　入札保証金及び契約保証金　免除。

⑶　入札者に要求される事項　この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、学長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

⑷　入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。

⑸　契約書作成の要否　要。

⑹　落札者の決定方法　本公告に示した物品を納入できると国立大学法人京都大学が判断した入札者であって、国立大学法人京都大学契約事務取扱規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

⑺　手続における交渉の有無　無。

⑻　その他　詳細は、入札説明書による。なお、入札説明書等で当該調達に関する環境上の条件を定めた調達であると示されている場合は、十分理解した上で応札すること。

5　Summary

⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Nagahiro Minato, President, Kyoto University

⑵　Classification of the products to be procured : 24

⑶　Nature and quantity of the products to be purchased :

A　High performance genome sequence analyzer 1 Set

B　High Precision Plasma Etching System 1 Set

C　High-Speed Deflection Control System for Electron-Beam Lithography 1 Set